

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 21 年 11 月 26 日 (2009.11.26)

【公表番号】特表 2009-520352 (P2009-520352A)
【公表日】平成 21 年 5 月 21 日 (2009.5.21)
【年通号数】公開・登録公報 2009-020
【出願番号】特願 2008-545593 (P2008-545593)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/673 (2006.01)

【 F I 】

H 0 1 L 21/68 T

【手続補正書】

【提出日】平成 21 年 10 月 9 日 (2009.10.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板キャリアを開放するためのシステムにおいて、

1 つ以上の基板を保持するように適応された基板キャリアと、

基板キャリア搬送システムから基板キャリアを受け取るためのロードポートと、
を備え、

上記ロードポートは、ドア開放機構を含み、上記ドア開放機構は、基板キャリアドアを
上記ドア開放機構に対して保持するために真空圧を使用するように適応される、
システム。

【請求項 2】

上記ドア開放機構は、真空圧を真空源から上記基板キャリアのドアへ加えるように適応さ
れたポートを含む、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 3】

上記ドア開放機構は、更に、真空圧を上記真空源から上記基板キャリアのドアへと向ける
ように適応された 1 つ以上のチャネルを含む、請求項 2 に記載のシステム。

【請求項 4】

上記ドア開放機構は、更に、上記基板キャリアのドアと結合し、上記基板キャリアの上記
ドアを上記ドア開放機構と整列させるように適応された 1 つ以上のキネマチック (kinema
tic) 特徴部を含む、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 5】

上記ドアは、上記ドア開放機構が上記ドアに隣接しているときに、上記ドア開放機構のポ
ートと整列するように配設される 1 つ以上のカップ特徴部を含み、

上記 1 つ以上のカップ特徴部は、上記ドア開放機構に対するシールを生成するよう適応
される、請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 6】

上記ロードポートは、更に、上記基板キャリアが上記ロードポートに隣接して配設される
ときに、上記基板キャリアの周辺にガス流を加えるように適応される、請求項 1 に記載の
システム。

【請求項 7】

ロードポートにおいて基板キャリアを受け取るステップと、

上記ロードポートのドアオープナーを上記基板キャリアのドアと整列させるステップと、

上記ドアを保持するため上記ドアオープナーを介して上記ドアへ真空圧を加えるステップと、
を備えた方法。

【請求項 8】

上記基板キャリアの周辺にガス流を加えるステップを更に備えた、請求項 7 に記載の方法。

【請求項 9】

上記基板キャリアの上記ドアを取り外すステップと、上記基板キャリアのあるレベルより下へ上記ドアを下降させるステップと、を更に備えた、請求項 7 に記載の方法。

【請求項 10】

基板キャリアに使用するための装置において、

ドア開放機構を含むロードポートを備え、上記ドア開放機構は、基板キャリアドアを上記ドア開放機構に対して保持するため真空圧を使用するように適応される、装置。

【請求項 11】

上記ドア開放機構は、真空圧を真空源から上記基板キャリアの上記ドアへと加えるように適応されたポートを含む、請求項 10 に記載の装置。

【請求項 12】

上記ドア開放機構は、更に、真空圧を上記真空源から上記基板キャリアの上記ドアへと向けるように適応された 1 つ以上のチャンネルを含む、請求項 11 に記載の装置。

【請求項 13】

上記ドア開放機構は、上記基板キャリアの上記ドアに結合し、上記基板キャリアの上記ドアを上記ドア開放機構と整列させるように適応された 1 つ以上のキネマチック特徴部を含む、請求項 10 に記載の装置。

【請求項 14】

上記ドアは、上記ドア開放機構が上記ドアに隣接しているときに、上記ドア開放機構のポートと整列するように配設される 1 つ以上のカップ特徴部を含み、

上記 1 つ以上のカップ特徴部は、上記ドア開放機構に対するシールを生成するよう適応される、請求項 10 に記載の装置。

【請求項 15】

上記ロードポートは、上記基板キャリアが上記ロードポートに隣接して配設されるときに、上記基板キャリアの周辺にガス流を加えるように適応される、請求項 10 に記載の装置。